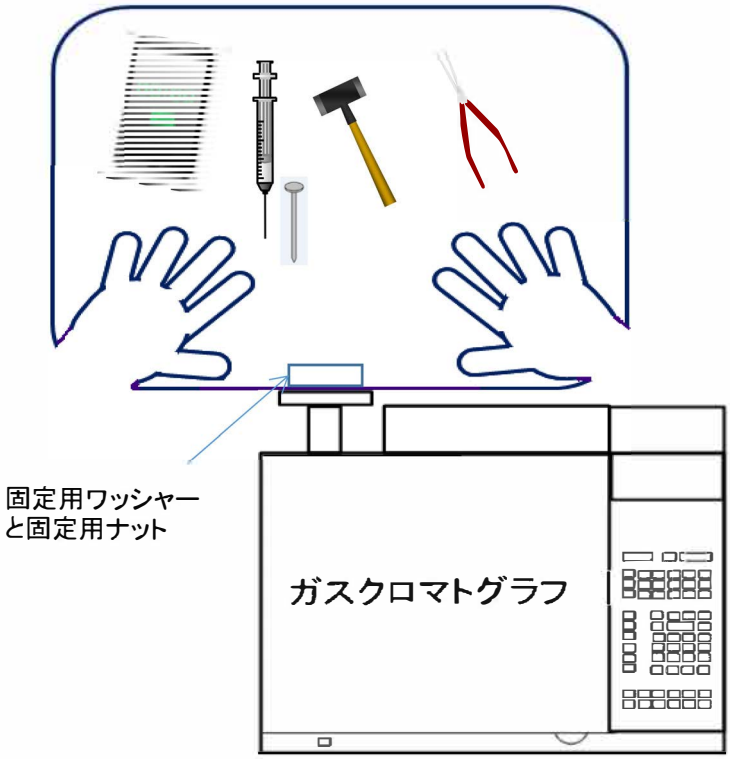
大気遮断用サンプリングシステム

特許出願中
特願2014-17807

・微量ガス分析
・サンプル注入時の大気の影響を
受けやすいサンプル分析



・グローブバッグとセプタムナットを一体化
・グローブバッグ内でサンプリングしそのまま注入
・ガスクロへサンプル注入時の大気の影響を最小化

Ken ケン商品開発株式会社
〒183-0005 東京都府中市若松町1-5-45
TEL: 042-306-6040 FAX: 042-306-6041
URL http://www.ken-pd.com
E-Mail info@ken-pd.com